

# 非球面形状のナノ計測に関する研究

特開2003-279345

## 研究の背景

### 研究目的

形状精度50nm以下の  
超高精度非球面形状の実現



### 研究課題

走査基準の高精度化

測定プローブの高精度化

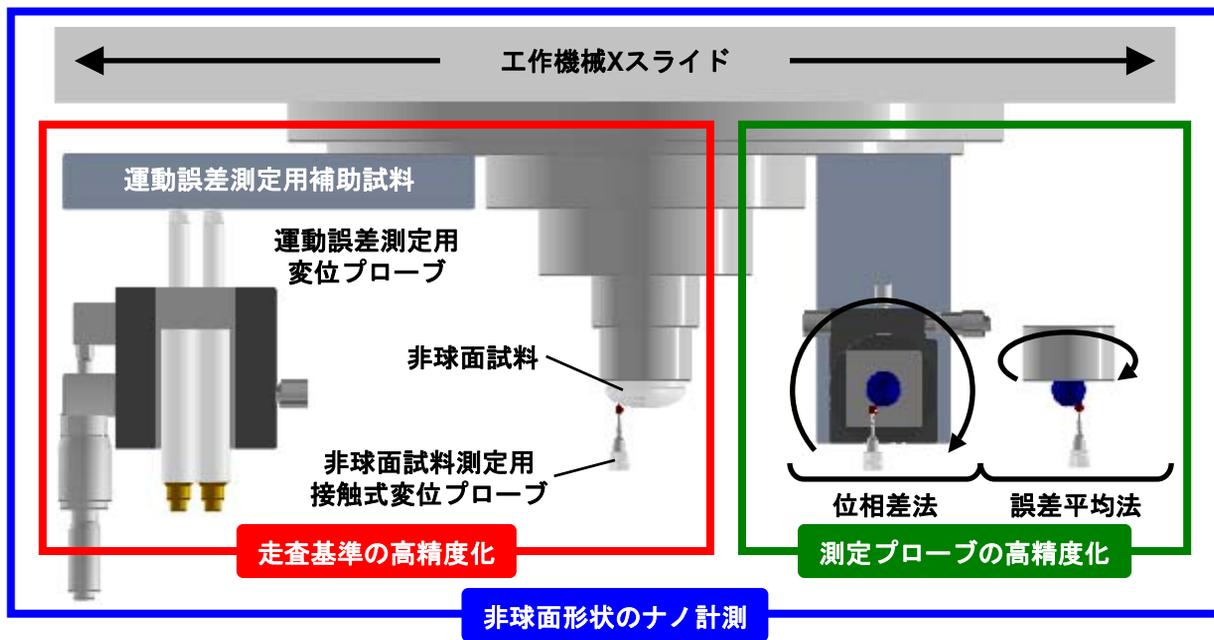
①加工機スライドの運動誤差の高精度計測

②プローブ出力の線形誤差の自律校正

③接触式プローブ先端球の形状誤差の自律校正

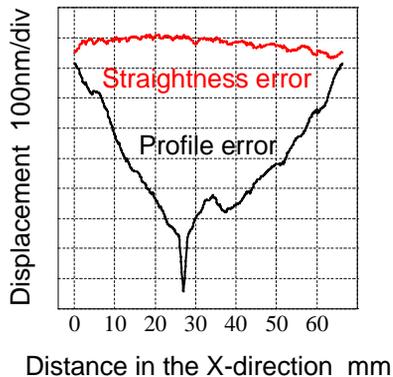
知的精密測定法による机上ナノ計測技術の開発

## 加工机上測定システム

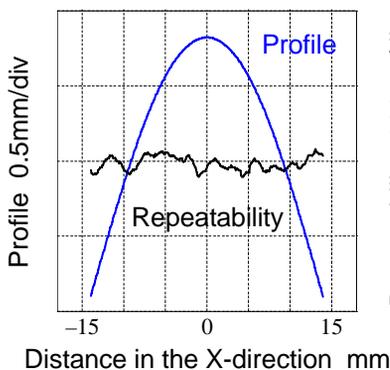


## 実験結果

スライドの  
運動誤差測定



非球面形状測定



プローブ先端球の  
形状誤差測定

